

真空系统元件 SELVACS 吸盘VSP Series 追加种类



SELEX VACUUM SYSTEM



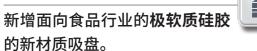
满足广泛需求的

丰富产品系列

为了满足食品、搬送、半导体、二次电池等行业对真空的

广泛需求,吸盘VSP系列又进一步增加了种类。

确保食品安全



●采用符合日本食品卫生法及FDA标准的材质。

硬度20° 【符号YS2】

硬度40° 【符号YS4】













确保洁净化

对应吸盘形状

● 波纹管型: φ15~φ50 (φ15仅限材质YS2)

● 多段波纹管型: φ20~φ50

新增低发尘吸盘支架。

- ●与以往的弹簧式支架相比,减少发尘。
- ●实现可动时的低噪音。

噪声等级

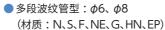
※) 根据本公司测量条件。

适用于小物

新增小直径尺寸。

对应吸盘形状

● 波纹管型: ø2、ø4 (材质:QN、S、SE)



半导体制造工序用



适用于不齐的工件

新增缓冲**行程**的选择范围。

●增加了长行程种类,适用于多段波纹管、软盘、 柔软波纹管、薄物。



适用于倾斜的工件

在头部摆动选择项中追加柔性支架。

柔性支架(CF)

备有1mm行程,减缓工件接触时的冲击。 工件脱落时,通过弹簧复位到原位置。





适用于薄物

在用于搬送薄型工件的扁平型(F)中 新增了扁平吸入流量增加型(FH)。



导体制造工序用

●增加流路孔,吸附力大幅提高。

吸入流量增加型





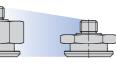
吸入流量 Max. 2.5 倍 吸着力 Max. 6 倍

流路 追加4个孔

●螺纹适配器可控制高度,实现小型化、轻量化。

吸入流量增加型用





重量 Max. 减小 45.5% 高度 Max. 减小 27.4%

对应二次电池

将二次电池对应规格(-P4)标准化。



※除了本页介绍以外,还扩大了可选择的对应选择项。 详情请参阅吸盘系列体系表。

确保工件的外观品质

新增了吸盘橡胶表面处理(选择项),对吸盘表面进行特殊处理以减少吸痕。

纤维起毛型(-NF、-SF)

采用吸盘表面的纤维(尼龙或环),避免直接接触工件, 可防止橡胶材质定位。

吸痕减少型(-ER)

通过化学液体对丁腈橡胶表面进行改良,以减少吸痕。

防锁死型(-DL)

平滑的特殊涂层。

可有效防止轻量工件、薄型工件的张贴。

氟类涂料型(-FG)

经过特殊处理改良后的表面,可防止在工件上粘贴 或粘贴蛇腹部。提高吸盘的耐久性及耐磨损性。

透明丙烯材料 涂装电镀树脂

推荐工件

※减少吸痕的程度因环境和工件而异,请务必根据实物进 行吸附试验后再选择机种。

吸盘系列体系表

吸盘形状-吸盘尺寸・吸盘材质・选择项一览表

吸盖心体						` -						吸盘	尺寸																			吸盘	显材质		Δ	۸ – و سوا	(au)						选择	项	
ı	吸盘形状		吸盘 形状 符号 (0.7		5 2		3 3.5	5 4	5	6	8	10	15	20 2	25 3	0 3	35 4	.0 5	50 6	50 70	80	100 1!	50 2	100 橡 下	請 硅胶 橡肥	: 聚氨醇 交 橡胶	氟 橡胶	导电性 硅橡胶	导电性 最大 最大 最大 最大 最大 の に に の に の に の に の に の の に の に の に の の の に の の の の の の の の の の の の の	电性 符NBR 日本 和用 型 型) N	拾 娘品 HNBR IBR G HN	EPDM EP	\vdash	耐油 NBR 硅	超软			POM		自由支架(头部摆动)	灵活 支架 (头部 摆动)	防坠 落阀	表面 树I を理 附I 像胶	上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上
	普通型	Д	R	-	• -	•		-	•	-	•	•	•	•	•			- (• -	•	•		• •	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	- -	-	-	-	•	•	•	• -	•
标准型	深凹	Д	A	-	- -		-	- -	_	-	-	-	-	•	•			- (• -	•	• .	_	- •	•	•	•	•	-	•	• •	•	-	-	-	- -	-	-	-	•	•	•	• -	•
	小型	Q	RM	•	•	•		• -	•	-	-	-	-	-	- -	- -	-	_ -	- -	_	- -	-	_ -	_	- •	•	•	•	•	•	•	• •	•	-	-	-	- -	_	-	-	-	•	•	• -	
海绵型		Δ	S	-	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	•	•	•			• .	-		- •	_	• .	_	- -		_	-	-	-	_ -	- -	-	-	-	-	- •	_	-	-	•	•	•	- -	•
波纹型			В	-	- -	•	-	- -	•	-	•	•	•	•	•			-			• -	•	•	_	-	•	•	•	•	-	•	- •	•	-	-	•	• -	-	-	-	•	•	•	安装部	拥 ●
多段波纹型			W	-	- -	- -		- -	-	-	•	•	•	-	• .	-		- (- -	-	_ -	_	- •	•	•	•	-	-	•	• •	•	-	-	•	• -	-	-	-	•	•	•	• -	•
椭圆型		53	Е	-	_ -	2×.	4 -	_ 3.5×	4×10 4×20 4×30	0 5×10 0 5×20 0 5×30	6×10 6×20 6×30	8×20 8×30	-	-		- -	_	_ -	- -	_	- -	-	_	_	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	- -	-	-	-	•	•	•	• -	•
柔软型		77	L	-	- -		-	- -	•	-	•	•	•	•	• -	-		- (- -	-	_ -	_	- •	•	_	-	•	-	• .	- -	-	•	-	-	- -	_	-	-	•	•	•	• -	•
柔软波纹型		77	LB	-	- -		-	- -	-	-	•	•	•	•	• -	- -	-	_ -	- -	_	- -	-	- -	_	- •	•	•	-	•	-	• .	- •	•	-	-	-	- -	-	-	-	•	•	•	• -	•
防滑型		Д	K	-	_ -	- -	-	- -	_	-	_	-	•	-	•	-		- (- -	_	_	_	_ -	•	•	•	-	-	•	- -	-	_	•	-	- -	_	_	-	•	•	•	_ -	•
薄物用型		Д	Р	-	- -	- -	-	- -	-	-	-	•	•	•	• .	- -	-	_ -	- -	_	- -	_	_ -	_	- •	•	•	•	-	-	• .	- -	-	•	-	-	- -	-	-	-	-	•	•	• -	•
扁平型	吸入流量 标准 吸入流量 增加		F	-	- -		-	- -	_	_	_	_	•	•	•			_	- -	_		_	- -	_	- •	•	•	•	•	-	•	- -	-	-	-	-		_	_	-	•	•	•	• -	•
New	ッ 吸入流重 増加			-	_ -	- -	-	- -	_	-	_	-						_ -	- -	-	- -	-	- -	-	- •		-			-	•	- -	_	-	-	-	- -	-	-	-	•		•	• -	•
防吸痕型		1	Q	-	- -	- -	-	- -	_	_	-	_	•	-	•	-		_ -	- -	-	- -	-	_ .	_	- -	- -	_	-	-	-	_ .	- -	_	-	-	-	- -	•	•	•	-	标准●	•	- -	

为新追加的种类。

吸盘形状-支架形状一览表

支架形状	VSP-A	VSP-B	VSP-C	VSP-D	VSP-E	VSP-F	New	(New)	VCD LIC	VCD LID	//CD FILIVI	VCD LIE	VSP-HEW	\/CD	\/CD DE
及盘形状	VSP-MA	VSP-MB	VSP-MC	VSP-MD	VSP-ME	VSP-F	VSP-LFC	VSP-LFD	VSP-TIC	V3P-ND	V3F-HDVV	V3P-NE	VOP-FIEVV	V SP-AE	V3P-DE
示准型	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
与 绵型	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
皮纹型	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	_
多段波纹型	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
	•	•	•	•	_ _	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
柔软型	•	•	•	•	_ _	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
次波纹型	•	•	•	•	_ _	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
	•	•	•	•	_ _	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
事物用型 第	•	•	•	•	•	•	•	•	_	•	•	•	•	_	_
	•	•	•	•	_ _	•	•	•	•	•	•	•	•	_	-
方吸痕型	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_

为新追加的种类。

支架形状

文第	EH547	7							
符号	标准	VSP-A	VSP-B	VSP-C	VSP-D	VSP-E	VSP-F	VSP-LFC	VSP-LFD
19 5	小型	VSP-MA	VSP-MB	VSP-MC	VSP-MD	VSP-ME	-	-	-
		固定式 抽真空口 向上	固定式 抽真空口 横向	缓冲式 抽真空口 向上	缓冲式 抽真空口 横向	直接安装型 固定式	直接安装型 缓冲式	低发尘 缓冲式 抽真空口 向上	低发尘 缓冲式 抽真空口 横向
Ŧ	杉状								

符号 标准	VSP-HC	VSP-HD	VSP-HDW	VSP-HE	VSP-HEW	VSP-AE	VSP-BE
	轻量型 带缓冲 抽真空口 向上	轻量型 带缓冲 抽真空口 横向	轻量型 带缓冲 抽真空口 双横向	低背型 直接安装固定式 抽真空口 横向	低背型 直接安装固定式 抽真空口 双横向	螺纹固定式 抽真空口 向上	螺纹固定式 抽真空口 横向
形状							

吸盘形状一览表

吸盘形状一览表				
	1	用途示例	特点	吸盘尺寸
普通型	Д	适用于平整的工件(坚硬且较厚的工件)		1 2 3 4 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200
深凹型标准型	Д	适用于球形工件(苹果及球)	通用且普通的吸盘类型。 备有多种吸盘尺寸、吸盘材质、支架形状。 备有3种吸盘形状(普通型、深凹型、小型)。	15 20 25 30 40 50 60 80 100
小口径型	Q	适用于小型半导体零件		0.7 1 1.5 2 3 4
海绵型	Δ	适用于建筑物的外墙材料、 小型石材及贝壳形工件	表面凹凸不平的工件 (建筑物的外墙材料、小型石材及贝壳形 工件)	10 15 20 25 30 35 50 70 100
波纹型	<u></u>	适用于速食包装及食品等的包装袋	采用蛇腹结构,柔软仿照工件的波纹吸盘。 通过安装防吸痕用树脂附件,适用于FPD、 玻璃基板等的搬送。	2 4 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
多段波纹型			采用蛇腹结构,柔软仿照工件的波纹吸盘。 通过4段蛇腹结构,吸盘吸附面大幅振动, 仿照工件。	6 8 10 20 30 40
椭圆型	53	吸附空间有限的工件 (基板、半导体、圆棒)	无法确保圆状吸附面时, 便于使用长圆形吸盘。 备有适用于小吸附面工件的小尺寸(2×4~)。	2 × 4 3.5 × 7 4 × 10 4 × 20 4 × 30 5 × 10 5 × 20 5 × 30 6 × 10 6 × 20 6 × 30 8 × 20 8 × 30
柔软型	7	适用于成形品的取出及易损伤的工件	吸盘柔软性优异,耐工件性优异的吸盘。 仅易损伤的工件柔软且吸痕少。	4 6 8 10 15 20 30 40
软波纹型	**		吸盘柔软性优异,耐工件性优异的吸盘。 采用波纹管结构,可在工件倾斜时使用。	6 8 10 15 20
防滑型	Д	适用于冲压部件等附着油份的工件	吸盘吸附面设有夹紧槽,附着油份的铁板 防止搬送时滑动的吸盘。	10 20 30 40 50
薄物用型	Л	适用于薄板、聚氯乙烯等薄型工件	吸盘吸附面加薄筋部,使之更紧贴工件的 吸盘。 适用于吸附薄型工件,也可减少重复吸附 (2个)。	8 10 15 20
扁平型			通过采用扁平吸附面形状,抑制吸附时的工件变形,重视减少起皱的吸盘。	10 15 20 25 30
防吸痕型		适用于液晶玻璃、涂装工序、 半导体制造装置等	吸盘材料使用树脂材质的类型。 标配可随工件微小倾斜的柔性支架。 不易产生吸痕,真空破坏时的工件脱离性 也很好。	10 20 30

各橡胶材质、海绵材质

		吸盘材质	丁腈 橡胶	符合日本 食品卫生法 NBR	HNBR	硅橡胶	导电性 硅橡胶		软 象胶 硬度40°	聚氨酯 橡胶	氟橡胶	氟硅 橡胶	EPDM	导电性 聚丁橡胶 (低电阻型)	导电性 NBR 低电阻型)	氯丁橡胶 (海绵型)	硅橡胶 (海绵型)
项	目	订购符号	N, NH(**1)	G	HN	S	SE	YS2	YS4	U	F	FS	EP	Е	NE	无符号	S
用	途		薄z	板相关	瓦楞纸板 薄木板 食品它工作 以品的一件 以下的 一件 等原的	半長 模具成形 薄型 食品	品的取出 工件	食品	相关	瓦楞纸板 薄木板 铁板	化学药品 环境高温 工件	模具 成形品 的取出	要求耐 光、耐臭 氧的用途 含水下的 环境下的 使用	半导体 一般 工件 (防静电)	半导体	表面凹 凸不平 的工件	表面凹凸不平的工件食品相关
吸盘	計颜色	<u>五</u>	黑色	浅灰	黑色	纯白	黑色	粉色	蓝色	深蓝色	灰色	深橙色	黑色	黑色	黑色	黑色	深橙色
	各	标准型	50°~80°	60°∼70°	50°~70°	50°	60°	_	_	55°~70°	60°~70°	_	50°~70°	70°	60°∼70°	_	_
	吸	波纹型	50°	_	50°	50°	60°	20°	40°	55°	60°	_	50°	_	60°	_	_
	影	多段波纹型	50°	50°	50°	50°	_	20°	40°	55°	50°	_	50°	_	60°	_	_
	各吸盘形状的	椭圆型	40°~50°	_	50°	40°~50°	50°~60°	_	_	55°	50°	_	50°	70°	70°	_	_
		柔软型	40°	_	_	40°	60°	_	_	_	_	40°	_	_	50°	_	_
	表面硬度	软波纹型	40°	_	50°	40°	60°	_	_	55°	_	_	50°	_	60°	_	_
	度 留	防滑型	50°	_	_	50°	_	_	_	55°	60°	_	_	_	60°	_	_
44-	(肖氏A)	扁平型	60°	_	_	40°	40°	_	_	50°	50°	_	_	_	60°	_	_
物理特性	<u>A</u>	薄物用型	40°	_	_	40°	_	_	_	55°	50°	40°	_	_	60°	_	_
特	高温	且使用极限温度	11	0℃	140℃	18	0℃	_	_	60℃	230℃	180℃	150℃	100℃	110℃	80℃	180℃
IT [低温	且使用极限温度	-30	o℃	-30℃	-40)°C	_	_	-20℃	-10℃	-50℃	-40℃	-50℃	-30℃	-45℃	-40℃
	耐气	〔候性		7	0	(_	_	0	0	0	0	0	Δ	0	0
	耐臭	皇 氧性	>	<	0	(_	_	0	0	0	0	×	×	0	0
	耐酸	姓		2	Δ			_	_	×	0	0	0	Δ	Δ	Δ	0
	耐硐	战性			0	(_	_	×	×	0	0	0	0	0	0
	耐油	(汽油•轻油)			0			_	_	0	0	Δ	×	×	0	×	Δ
	油性	(苯•甲苯)		Δ			7	_	_	Δ	0	Δ	×	×	Δ	Δ	Δ
体积电阻率		_		_	_	10⁵Ω·cm以下	_	_	_	_	_	_	200Ω·cm以下	200Ω·cm以下	_	_	

评价判断方法➡②:优秀、○:良好、△:一般、×:不可 ※1:吸盘材质订购符号NH仅限防滑型可选择。 注1:关于物理性质,描述了吸盘材质中使用的一般合成橡胶的特性。 注2:使用高温极限温度时的实际使用为瞬时使用时的性质,持续一定时间时,请充分确认后再使用。 注3:选择表面处理(选择项)毛型纤维型时,氟橡胶的高温使用极限温度为200℃。

树脂材质

		PEEK	POM	导电性PEEK
项	目 订购符号	K	M	KE
用	途	半导体及液晶制造装置	各种生产线 食品相关元件 包装机械	半导体及液晶制造装置 电子元件
吸拍	盘颜色			
		米色	白色	黑色
	高温使用极限温度	250℃	95℃	250℃
	低温使用极限温度	-50℃	-60℃	-50℃
A-fra	耐气候性	0	×	O
押	耐酸性	0	×	0
物理性能	耐碱性	0	Δ	0
能	自润滑性	0	0	0
	耐磨损性	0	0	0
	体积电阻率	-	-	10⁵~106Ω · cm
207.4		○・自好 △・一般 >・不可		

评价判断方法➡◎:优秀、○:良好、△:一般、×:不可注:物理性质为吸盘部树脂材质的特性,并非含防吸痕型吸盘支架部在内的特性。请考虑使用的真空吸盘支架、防吸痕型吸盘支架部分的规格进行选型。注2:物理性质为各材质的一般特性,并非保证值。使用时请根据实物进行确认。注3:使用高温极限温度时的实际使用为瞬时使用时的性质,持续一定时间时,请充分确认后再使用。注4:体积电阻率为材料厂商公布的代表值,并非保证值。

关联产品

真空系统元件 SELVACS

- 紧凑型设计 各元件设计紧凑、省空间。
- ●机型种类丰富 系列机种、种类丰富,适用于广泛的领域、用途。
- ●单元化、模块化 致力于实现作为核心部分的发生器及真空泵系统的单元化、模块化, 使其更节省空间、便于使用。



样本编号: CC-796C

本样本中的产品及相关技术是外汇及国际贸易法中总体限制的对象。

需从日本出口本产品及其相关技术或软件时,根据日本法律请务必注意防止将其用于与军火、武器相关的用途中。

The goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are subject to complementary export regulations by Foreign Exchange and Foreign Trade Law of Japan.

If the goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are to be exported from Japan, Japanese laws require the exporter makes sure that they will never be used for the development and/or manufacture of weapons for mass destruction.